課題番号 : F-20-WS-0234

利用形態 : 技術代行

利用課題名(日本語) : Pt 電極の作製

Program Title (English) : Fabrication of Pt electrode

利用者名(日本語) : <u>陳柏陽 1)</u>
Username (English) : <u>B. Chen 1)</u>

所属名(日本語) : 早稲田大学大学院創造理工学研究科

Affiliation (English) : School of Creative Science and Engineering, Waseda Univ.

キーワード/Keyword : 成膜・膜堆積、スパッタ、太陽電池、電極

1. 概要(Summary)

色素増感太陽電池(DSSC)の測定について、Pt 電極の性能は結果に大きな影響を与えることが考えられた。今回は高品質な Pt 電極を作製するため、ガラス面にスパッタ法で Pt の成膜を行った。

2. 実験(Experimental)

【利用した主な装置】

- ・クリーンルーム ×2
- イオンビームスパッタ装置

【実験方法】

基板としては FTO (Fluorine-doped tin oxide) 透明導電性ガラス基板を用いた。元の寸法は 100mm×100mmと大きかったので、これを 15mm×30mm 5 枚、20mm×30mm 3 枚、40mm×50mm 2 枚に切って洗浄した。これに、以下の条件でスパッタを行った。ただし、Ti 層は Pt 層の密着性を向上させるためのものである。

装置:イオンビームスパッタ装置

膜厚:Pt 300nm /Ti 10nm

基板温度:室温

成膜面:SnO の無い面に成膜

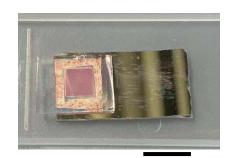
成膜:1バッチで処理

3. 結果と考察(Results and Discussion)

Pt スパッタしたガラス基板を Fig. 1 に示すように、 TiO_2 薄膜の対面に挟んで使用された。測定結果として、Pt 面は電極として問題なく使用できた。

4. その他・特記事項(Others)

なし



10 mm

Fig.1 Picture of Pt electrode used for DSSC

<u>5. 論文・学会発表(Publication/Presentation)</u>なし

6. 関連特許(Patent)

なし